



OptoTech

MSI 300

Multifunktionales Stitching-Interferometer



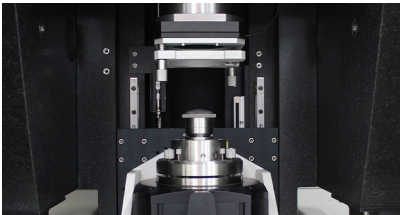
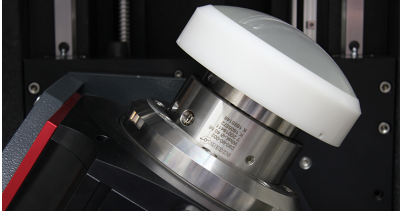
Multifunktionelles Stitching Interferometer zum Prüfen von hochaperturigen Sphären bis $\varnothing$ 300 mm.



OptoTech

Technische Daten

	MSI 300
Anwendung	Multifunktionelles Stitching Interferometer
Messbereich Durchmesser	0 mm - 300 mm
Verfahrweg B	-90 ° - 90 °
Verfahrweg C	0 ° - 360 °
Verfahrweg X	-150 mm - 150 mm
Verfahrweg Y	-25 mm - 25 mm
Verfahrweg Z	0 mm - 1000 mm
Anzahl der Achsen	5 (X, Y, Z, B, C)
Strombedarf (andere auf Anfrage)	1 KW
Abmessungen	Breite: 1500 mm, Höhe: 2650 mm, Tiefe: 1500 mm; mit Interferometer Modul
Gewicht (ca.)	2500 kg
Disclaimer	Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech.





Highlights

- Das neue multifunktionale Stitching-Interferometer MSI 300 wurde speziell zur Prüfung von hochaperturigen Sphären bis 300 mm Durchmesser entwickelt
- Messaufbau aus Granitstein, passiv luftgelagert auf Rohr-Schweißgestell montiert
- Hochpräziser Radienschlitten in Z-Achs-Anordnung
- Verschiedene Optionen leistungsstarker Interferometermodule (LT Ultra Module 4" / 6" und DHS FI1 100D 4") und entsprechender Softwarelösungen zur Auswertung Ihrer Messergebnisse
- Invers-Anbau des Interferometer-Modul auf X/Y-Kreuzschlitten
- Hochauflösende Schwenkachse (B-Achse) zur Positionierung hochaperturiger Sphären im Strahlengang
- Direkt-angetriebene Drehachse (C-Achse) zur Drehung von hochaperturigen Sphären
- Standard Werkstück-Aufnahme HD-40 (weitere optional)
- Kompakte Maschineneinhausung im OptoTech-Design mit integriertem PC-Arbeitsplatz
- Bedienung: Wahlweise konventionell manuell oder mit automatischer Achssteuerung über µStitch MSI-Software

Optionen

- Passende Fizeau-Messobjektive
- Kipptisch zur Planflächenmessung bis Ø 300 mm
- Verschiedene Werkstück-Aufnahmen